



校正証明書

依頼者 株式会社 渋谷光学
 住所 埼玉県和光市下新倉 3-22-2
 品名 対物ミクロメータ
 型式又は性能 OB2009
 製造番号 20130225
 製造者 株式会社 渋谷光学
 校正項目 寸法
 校正方法 JQA 校正要領書による (文書番号 E314403)
 環境条件 温度 20°C±0.5°C, 湿度 55%±5%
 校正年月日 2013年3月5日

校正結果は次のとおりであることを証明します。

2013年3月6日

東京都世田谷区砧一丁目21番25号
 一般財団法人 日本品質保証機構
 計量計測センター

所長 中本文 男



校正結果 (標準温度 20°C)

目盛の長さ : 5 mm
 目 量 : 0.01 mm

単位 : mm

目 盛	測定値	目 盛	測定値
0.5	0.4996	3.0	2.9994
1.0	0.9996	3.5	3.4993
1.5	1.4997	4.0	3.9992
2.0	1.9995	4.5	4.4991
2.5	2.4993	5.0	4.9991

校正の不確かさ

$$U = (1.0 + L/2000) \mu\text{m}$$

(ただし、L は測定長 (mm))

校正の不確かさは拡張不確かさであり、包含係数 $k=2$ で決定され、約 95% の信頼の水準をもつと推定される区間を定める。

使用した常用参照標準器等

(品名)	(製造者名)	(型式又は能力)	(識別番号)
波長安定化 He-Ne レーザ	HP	5518A	053-07-003

備 考 1. 線膨張係数は $8.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ とした。
 2. マーキング (黒) 側の目盛線を基点とした。

特記事項 なし

以 上

この証明書は、国内または海外の国家標準にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。日本品質保証機構 計量計測センターは、A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) によって ISO/IEC 17025-2005 に基づく校正機関として認定されています。



校正証明書

依頼者 株式会社 渋谷光学
 住所 埼玉県和光市下新倉 3-22-2
 品名 対物マイクロメータ
 型式又は性能 OB2001
 製造番号 20130225
 製造者 株式会社 渋谷光学
 校正項目 寸法
 校正方法 JQA 校正要領書による (文書番号 E314403)
 環境条件 温度 20°C ± 0.5°C, 湿度 55% ± 5%
 校正年月日 2013 年 3 月 5 日

校正結果は次のとおりであることを証明します。

2013 年 3 月 6 日

東京都世田谷区砧一丁目 21 番 25 号
 一般財団法人 日本品質保証機構
 計量計測センター

所長 中本文 男



校正結果 (標準温度 20°C)

目盛の長さ : 1 mm
 目 量 : 0.01 mm

単位 : mm

目 盛	測定値	目 盛	測定値
0.1	0.1000	0.6	0.5999
0.2	0.2000	0.7	0.7000
0.3	0.3000	0.8	0.8000
0.4	0.3999	0.9	0.8999
0.5	0.4999	1.0	0.9999

校正の不確かさ

$$U = (1.0 + L/2000) \mu\text{m}$$

(ただし、L は測定長 (mm))

校正の不確かさは拡張不確かさであり、包含係数 $k=2$ で決定され、約 95% の信頼の水準をもつと推定される区間を定める。

使用した常用参照標準器等

(品名)	(製造者名)	(型式又は能力)	(識別番号)
波長安定化 He-Ne レーザ	HP	5518A	053-07-003

備考 1. 線膨張係数は $8.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ とした。
 2. 寸法表示側の目盛線を基点とした。

特記事項 なし

以上

この証明書は、国内または海外の国家標準にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。日本品質保証機構 計量計測センターは、A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) によって ISO/IEC 17025-2005 に基づく校正機関として認定されています。